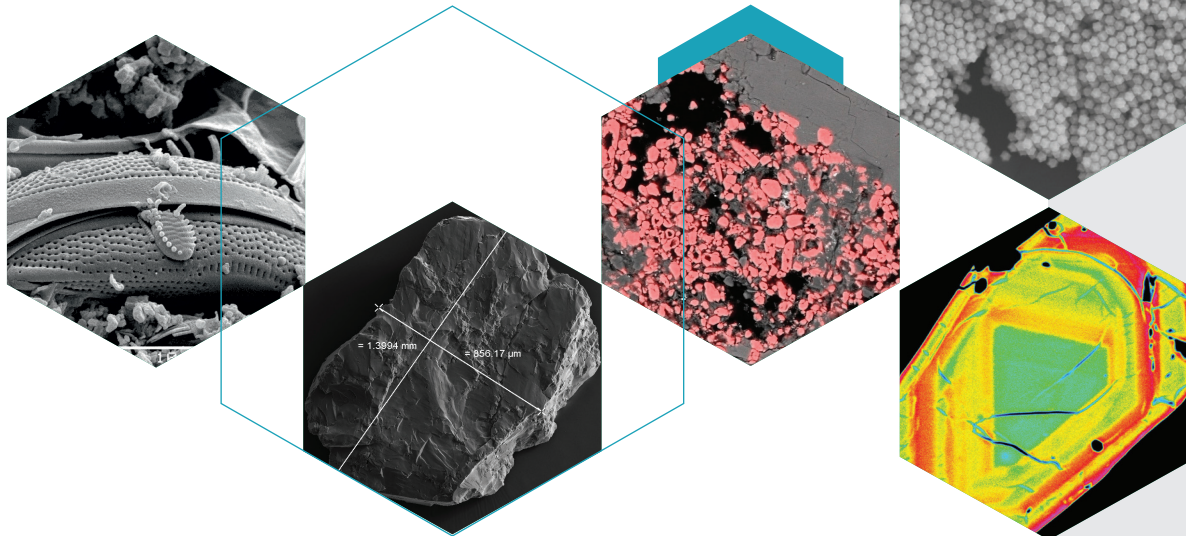


Skaningowa mikroskopia elektronowa SEM-EDS

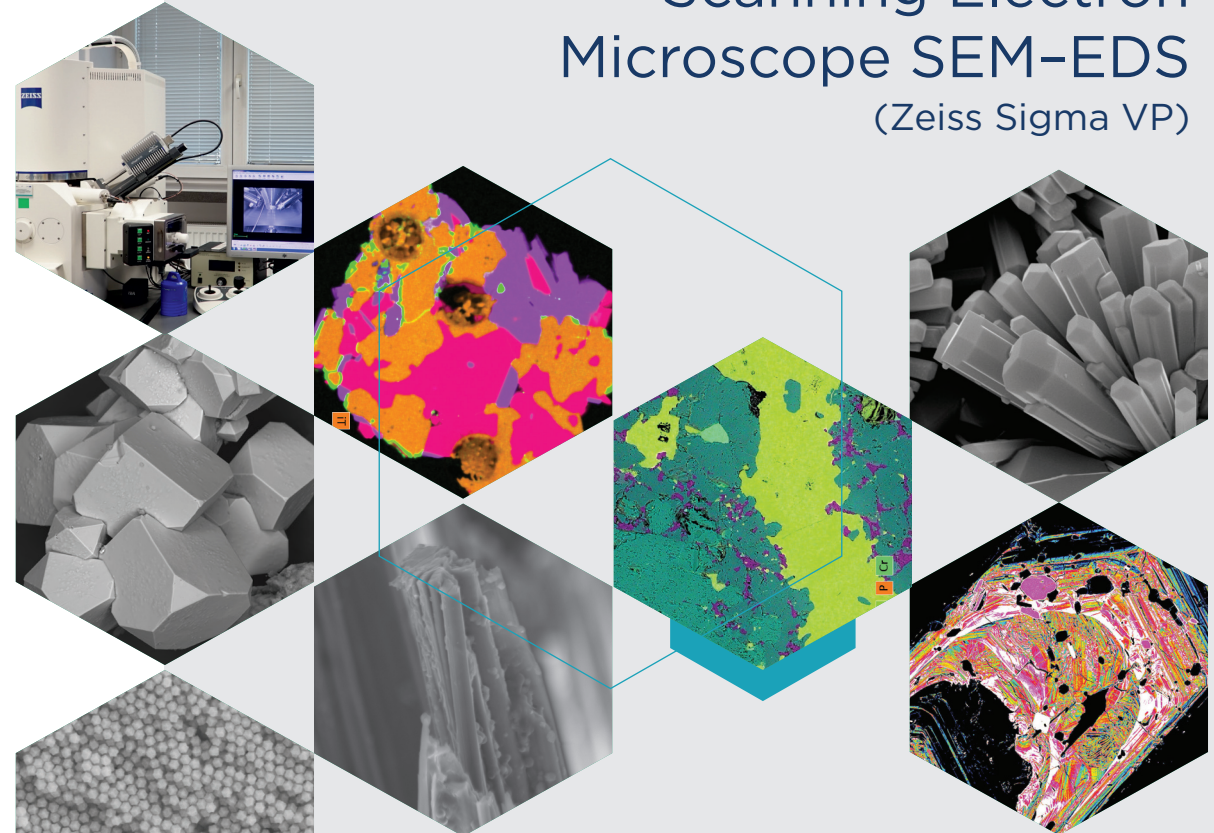
(Zeiss Sigma VP)

- obrazowanie elektronami wtórnymi (SE - Secondary Electrons) oraz elektronami wstecznie rozproszonymi (BSE - Back-Scattered Electrons)
- powiększenia od 50x do 500 000x
- możliwość pracy przy zmiennym ciśnieniu (VP - Variable Pressure) - obrazowanie powierzchni próbek bez konieczności ich napylenia warstwą przewodzącą (C, Au, Pt/Pd, Ir)
- punktowa oraz obszarowa analiza składu chemicznego próbki metodą EDS (Energy Dispersive Spectrometry) przy wykorzystaniu dwóch detektorów. Oznaczone pierwiastki: od C do U, przy limicie detekcji około 0.1% wag.
- automatyczny stolik umożliwiający skanowanie całej powierzchni próbki przy żądanym powiększeniu, w wyniku czego otrzymujemy panoramę/mozaikę koncentracji każdego pierwiastka (od C do U) oraz skan BSE/SE o dużej rozdzielczości
- maksymalne rozmiary badanych próbek ciał stałych: średnica do 250 mm, wysokość do 100 mm oraz masa do 1 kg



Scanning Electron Microscope SEM-EDS

(Zeiss Sigma VP)



- imaging of sample surfaces with Secondary Electrons (SE) and Back-Scattered Electrons (BSE)
- magnification from 50x to 500,000x
- Variable Pressure (VP) operation - imaging of sample surfaces without the need to apply a conductive coating (C, Au, Pt/Pd, Ir)
- point and area analysis of the chemical composition in a sample using Energy Dispersive Spectrometry (EDS) with two detectors. Elements detected: from C to U, with a detection limit of approximately 0.1 wt. %
- automatic stage for scanning the sample surface at a specified magnification, resulting in a mosaic map of elemental concentration (from C to U) and high resolution BSE/SE scans
- maximum dimensions of examined solid samples: diameter up to 250 mm, height up to 100 mm, and weight up to 1 kg